

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Панфилов Юрий Васильевич
2	Дата рождения (полная)	2 января 1948 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук 05.13.07 и 05.27.07
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре полупроводникового и электровакуумного машиностроения
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д.5 bauman@bmstu.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
	Ведомственная принадлежность организации	МОН
	Тип организации	ВУЗ
	Наименование подразделения	Факультет «Машиностроительные технологии»
	Должность	Заведующий кафедрой
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 11 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК);</p> <p>для членов, представляющих экономические науки: не менее 6 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, а также не менее 1 рецензируемой монографии):</p>	
	<p>1. Y V Panfilov, I A Rodionov, I A Ryzhikov, A S Baburin, D O Moskalev, E S Lotkov Ultrathin film deposition for nanoelectronic device manufacturing / Vacuum Science and Equipment. 26 conference with international participants IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 781 (2020) 012021 IOP Publishing doi: 10.1088/1757-899X/781/1/012021</p> <p>2. Y V Panfilov and A V Gurov Pulsed methods of thin film coatings deposition / 15th International Conference on Films and Coatings (ICFC 2021) Journal of Physics: Conference Series 1954 (2021) 012035 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1954/1/012035, 5 pp.</p> <p>3. Y V Panfilov, L L Kolesnik and A V Gurov Thin film coatings material particles creation by pulsed methods in vacuum / 28th International Conference on Vacuum Technique and Technology (VTT 2021) Journal of Physics: Conference Series 2059 (2021) 012017 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2059/1/012017, 4 pp.</p> <p>4. E S Lotkov, A S Baburin, I A Ryzhikov, O S Sorokina, A I Ivanov, A V Zverev, V V Ryzhkov, I V Bykov, A V Baryshev, Y V Panfilov and I A Rodionov ITO film stack engineering for low-loss silicon optical modulators / Sci. Rep. 12:6321 https://doi.org/10.1038/s41598-022-09973-5 (2022). 11 pp.</p> <p>5. I.A.Stepanov A.S.Baburin D.V.Kushnev E.V.Sergeev O.I.Shmonina A.R.Mataniin V.V.Echeistov I.A.Ryzhikov Y.V.Panfilov I.A.Rodionov Sputtered NbTi films for ultrahigh</p>	

performance superconducting nanowire single-photon detectors / *APL Mater.* 12, 021127 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0188420>, 16 pp.

6. Korshakov, N.D., Moskalev, D.O., Soloveva, A.A., Moskaleva, D.A., Lotkov, E.S., Ibragimov, A.R., Androschuk, M.V., Ryzhikov, I.A., Panfilov, Y.V., Rodionov, I.A. Aluminum Josephson junction microstructure and electrical properties modified by thermal annealing / *Sci Rep* 14, 26066 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74071-7> 10 pp.

7. Панфилов Ю.В., Цветков Ю.Б. Современная контактная литография – ключевой процесс микроэлектронного приборостроения / *Приборы*, 2020, № 1 (235), С. 46 – 53

8. Панфилов Ю.В., Левченко В.А. Упрочняющие покрытия на инструменте (аналитический обзор материалов междуна. конф.) / *Упрочняющие технологии и покрытия*, № 5, 2020, С.234 – 240

9. Панфилов Ю.В., Чжо Я., Лян М., Моисеев К.М., Колесник Л.Л. Возможности электронно-лучевой установки «Луч» для размерной микрообработки стекла и керамических материалов / *Наноиндустрия. Спецвыпуск 2020 (2s, том 13)* DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.2s.122.131

10. Панфилов Ю.В., Родионов И.А. Рыжиков И.А. Бабурин А.С. Москалев Д.О. Лотков Е.С. Осаждение сверхтонких пленок в вакууме для изделий наноэлектроники / *Наноиндустрия. Спецвыпуск 2020 (2s, том 13)* DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.2s.132.138

11. Панфилов Ю.В., Бабурин А.С., Родионов И.А., Цветков Ю.Б. Приборные применения плазменных эффектов / *Приборы*, 2020, № 5 (240), С.45 – 4812.

12. Панфилов Ю.В. Импульсные методы нанесения упрочняющих нанокристаллических углеродных покрытий / *Упрочняющие технологии и покрытия*, №2, 2021. С. 93 – 96

13. Панфилов Ю.В., Колесник Л.Л. Привносимая дефектность при формировании наноструктур в вакууме / *Наноиндустрия*, Т.15, № 3-4 (114), 2022 doi: 10.22184/1993-8578.2022.15.3-4.224.231, С.224 – 231

14. Панфилов Ю.В. Создание отечественного исследовательского вакуумного оборудования для нанесения упрочняющих покрытий / *Упрочняющие технологии и покрытия*.2023.Т.19, №2, DOI: 10.36652/1813-1336-2023-19-2-92-96, С. 92 – 96

15. Панфилов Ю.В., Левченко В.А. Тенденции развития технологии и оборудования для нанесения упрочняющих покрытий / *Упрочняющие технологии и покрытия*. 2024. Т.20, №5, DOI: 10.36652/1813-1336-2024-20-5-232-240, С. 232 – 240

8 Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)

9 Адрес электронной почты